

11













JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2003194648 A

(43) Date of publication of application: 09.07.2003

(51) Int. CI

G01L 19/04

G01F1/50、 G01L9/00、 G05D16/20

(21) Application number:

2001399910

(22) Date of filing:

28.12.2001

(71) Applicant: OMI TADAHIRO

TOKYO ELECTRON LTD

FUJIKIN INC

OMI TADAHIRO (72) Inventor:

SUGIYAMA KAZUHIKO

NISHINO KOJI UNO TOMIO

NAKAMURA OSAMU MATSUMOTO ATSUSHI

DOI RYOSUKE IKEDA SHINICHI

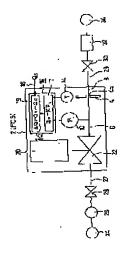
(54) PRESSURE SENSOR, PRESSURE CONTROLLER, AND TEMPERATURE DRIFT CORRECTION DEVICE OF PRESSURE TYPE FLOW CONTROLLER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a pressure sensor, a pressure controller and a flow controller capable of correctly detecting pressure regardless of temperature variation by automatically correcting the temperature drift of the pressure sensor.

SOLUTION: This temperature drift correction device of the pressure type flow controller, in which an upstream-side pressure sensor 10 for sensing upstream-side pressure P₁ is installed between an orifice 4 and a control valve 22, and an orifice passing flow rate is controlled by opening and closing the control valve 22 while calculating the orifice passing flow rate by the upstream-side pressure P1, comprises a temperature sensor 14 for measuring a fluid temperature; a memory means 64 for storing the relationship between the fluid temperature T and the output drift of the pressure sensor 10; and a temperature drift correction means for calculating the output drift amount of the pressure sensor 10 from data of the memory means 64 when the fluid temperature T changes and for eliminating and correcting the output drift of the pressure sensor 10 by the calculated output drift amount. By this structure, the temperature drift of the pressure sensor can be automatically corrected to accomplish correct flow control.

COPYRIGHT: (C)2003, JPO











OrderPatent

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-194648A)

(43) 公開日 平成15年7月9日(2003.7.9)

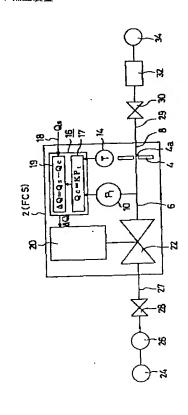
51)Int.Cl.	7	識別記号	F!			テーマコード(参考)
G01L	19/04		G 0 1 L	19/04		2F030
G01F	1/50		G01F	1/50		2F055
G01L	9/00		G 0 1 L	9/00	Z	5H316
G05D	16/20		G05D	16/20	N	
	審査請求	未請求 請求項の数 7	OL		(全 1 2]	頁)
21) 出願番号		P ^l n, 心。 F願2001-399910(P2001-399910)	(71) 出願ノ	0002050		
(22) 出願日		成13年12月28日(2001.12.28)	(71)出願ノ	宮城県 0002199 東京エ	仙台市青葉区米ク 967 レクトロン株式会	
			(71) 出願ノ	、 3900338 株式会	社フジキン	
		,	(74) 代理人		大阪市西区立売堀 174 杉本 丈夫	(2丁目3番2号 (外1名)

(54)【発明の名称】圧力センサ、圧力制御装置及び圧力式流量制御装置の温度ドリフト補正装置

(57)【要約】

【課題】 圧力センサの温度ドリフトを自動補正して温度変動に拘わらず圧力を正確に検出できる圧力センサ、 圧力制御装置及び流量制御装置を開発する。

・【解決手段】 本発明に係る圧力式流量制御装置の温度ドリフト補正装置は、オリフィス4とコントロールバルブ22の間に上流側圧力P₁を検出する上流側圧力センサ10を設け、上流側圧力P₁によりオリフィス通過流量を演算しながらコントロールバルブ22の開閉によりオリフィス通過流量を制御する圧力式流量制御装置において、流体温度を測定する温度センサ14と、流体温度Tと上流側圧力センサ10の出力ドリフトの関係を格納するメモリ手段64と、流体温度Tが変化した場合にメモリ手段64のデータから上流側圧力センサ10の出力ドリフト量により上流側圧力センサ10の出力ドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段から構成される。この構成により、圧力センサの温度ドリフトを自動補正して、正確な流量制御を可能とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 流体圧力を測定する圧力センサにおいて、流体温度を測定する温度センサと 流体温度と圧力センサ出力ドリフトの関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場合にメモリ手段のデータから圧力センサ出力ドリフト量を演算し、この演算出力ドリフト量により圧力センサの出力ドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段から構成され、流体温度が変動しても流体圧力を正確に測定することを特徴とする圧力センサの温度ドリフト補正装置。

【請求項2】 圧力制御用のコントロールバルブと流体 圧力を測定する圧力センサから構成された圧力制御装置 において、流体温度と圧力センサ出力ドリフトの関係を 格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場合にメモ リ手段のデータから圧力センサ出力ドリフト量を演算 し、この演算出力ドリフト量により圧力センサの出力ド リフトを消去補正する温度ドリフト補正手段から構成され、流体温度が変動しても流体圧力を正確に制御することを特徴とする圧力制御装置の温度ドリフト補正装置。

【請求項3】 流量制御用のオリフィスと、オリフィスの上流側配管に設けたコントロールバルブと、オリフィスとコントロールバルブの間に設けて上流側圧カP₁を検出する上流側圧カセンサから構成され、上流側圧カP₁によりオリフィス通過流量を制御する圧力式流量制御装置において、流体温度を測定する温度センサと、流体温度と上流側圧カセンサの出カドリフトの関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場合にメモリ手段のデータから上流側圧カセンサの出カドリフト量を演算し、この演算出カドリフト量により上流側圧カセンサの出カドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段から構成され、流体温度が変動しても流体流量を正確に制御することを特徴とする圧力式流量制御装置の温度ドリフト補正装置。

【請求項4】 流量制御用のオリフィスと、オリフィス の上流側配管に設けたコントロールバルブと、オリフィ スとコントロールバルブの間に設けて上流倒圧カP₁を 検出する上流側圧力センサと、オリフィスの下流側配管 に設けられて下流側圧力P2を検出する下流側圧力セン サとから構成され、上流側圧カP,と下流側圧力P。によ りオリフィス通過流量を制御する圧力式流量制御装置に おいて、流体温度を測定する温度センサと、流体温度と 上流側圧力センサ及び下流側圧力センサの出力ドリフト の関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場 合にメモリ手段のデータから上流側圧力センサ及び下流 側圧力センサの出力ドリフト量を演算し、この演算出力 ドリフト量により上流側圧力センサ及び下流側圧力セン サの出力ドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段 から構成され、流体温度が変動しても流体流量を正確に 制御することを特徴とする圧力式流量制御装置の温度ド リフト補正装置。

【請求項5】 前記メモリ手段は圧力がゼロのときに流体温度と圧力センサのゼロ点出力ドリフトの関係を格納し、前記温度ドリフト補正手段は、流体温度が変化した場合にメモリ手段のゼロ点出力ドリフト量を演算し、こ

場合にメモリ手段のセロ点出カドリフト量を演算し、この演算ゼロ点出カドリフト量により圧カセンサのゼロ点 出カドリフトを消去補正する請求項1、2、3又は4に

記載の温度ドリフト補正装置。

【請求項6】 前記メモリ手段は任意圧力におけるに流体温度と圧力センサのスパン出力ドリフトの関係を格納 し、流体温度が変化した場合にメモリ手段からスパン出力ドリフト量を演算し、圧力センサの出力又はこの出力の増幅量から前記演算スパン出力ドリフト量を消去補正する請求項1、2、3又は4に記載の温度ドリフト補正装置。

【請求項7】 請求項1乃至5のいずれか1項に記載の 温度ドリフト補正装置において、ガスを流体として流通 させ、このガス圧力又はガス流量を制御するガス供給シ ステムの温度ドリフト補正装置。

【発明の詳細な説明】

20 [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は主として半導体製造設備や化学プラント等で使用される圧力センサ、圧力制御装置又は圧力式流量制御装置に関し、更に詳細には、流体の圧力を計測する圧力センサの出力が温度変動によりドリフトする場合に、その温度ドリフトを自動的に消去することにより正確に流体圧力を検出して流体の圧力や流量を制御できる圧力センサ、圧力制御装置又は圧力式流量制御装置の温度ドリフト補正装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体製造設備や化学プラントなどでは、原料となる複数のガスを所定の流量で供給し、原料ガスを反応炉の中で化学反応させて目的ガスを生成する場合が多い。このような場合に、原料ガスの供給流量が正確でないと化学反応に過不足が生じ、目的ガスの中に原料ガスが残留する事態が生じる。特に、この原料ガスが引火性の場合には爆発の危険性が付きまとう。従って、原料ガスの化学反応を過不足無く行なうために、ガス流量を正確に供給制御することが必要となる。

【0003】従来、ガス流量を正確に制御するために、 配管内にオリフィスを配置し、オリフィスを通過する理論流量を表現する出来るだけ精度の良い流量式が選択されてきた。最初に用いられた流量式は流体を非圧縮性流体として近似するもので、 $Q_C = KP_2^{1/2} (P_1 - P_2)^{1/2}$ で表される。 P_1 はオリフィスより上流側の圧力、また P_2 はオリフィスより下流側の圧力を示す。Kは流体温度に依存した比例定数である。この流量式は P_1 と P_2 の二つの圧カパラメータで制御される。

【0004】実際のガス流は圧縮性流体であるから、上式の精度は良くない。そこで、圧力比P₂/P₁を約0.

50 5の臨界値より小さくすると、オリフィスを通過するガ

スの流速が音速に達し、この音速領域では理論流量式が $Qc = KP_1$ になることが知られている。臨界条件が満足される限り、この式は上流側流量 P_1 にのみ依存する単純性を有するだけでなく、圧縮性流体に対する正確なオリフィス通過流量を与えることでも知られている。

【0005】従って、非圧縮性流体という近似制御では $Qc = KP_2^{1/2}(P_1 - P_2)^{1/2}$ が使用され、臨界条件 $(P_2/P_1$ < ξ (P_1) では $Qc = KP_1$ が流量制御に 主に使用されている。これらの流量式を使用する場合 に、流体圧力 ξ (ξ) に、流体圧力 ξ (ξ) で加速が前提になる。即ち、前者においては上流側圧力 ξ) と下流側圧力 ξ の ξ の ξ (ξ) の ξ (ξ) では上流側圧力 ξ では上流側圧力 ξ の ξ (ξ) に ξ では上流側圧力 ξ の ξ (ξ) の ξ (ξ) に ξ (ξ) の ξ (ξ) に ξ (ξ) の ξ (ξ) に ξ (ξ) に ξ (ξ) の ξ (ξ) に ξ (ξ)

【発明が解決しようとする課題】流体圧力を測定するには、流体中に圧力センサを配置することが必要になる。従って、圧力センサは流体温度に極めて敏感になり、直ぐに流体温度 T と同一、即ち流体と平衡温度に到達する。流体圧力を正確に測定するには、圧力センサのサイズは流体の流れを撹乱しない程度に小さくする必要があり、この場合には平衡温度への到達速度は極めて速いと考えられる。

【0007】配管を流れるガス流体はできるだけ一定温度で流通するように制御されているが、実際の長時間流通では、かなりの温度変動が存在することが知られている。また、ガス流体を交換して流通させる場合には、ある時間帯では高温ガスが流れ、他の時間帯では低温ガスが流れることがある。従って、温度変動する流体を同一の圧力センサで計測すると、圧力センサ出力の温度ドリフト特性が問題となり、検出された流体圧力を補正する必要が生じる。

【0008】従来の圧力センサには、圧力の検出方式が どのようなものであれ必ず温度ドリフトが存在する。温 度ドリフトとは、圧力センサの周囲の環境温度が変化し たときに、圧力センサの出力が同じ圧力に対して変動す ることを云う。この出力ドリフトは流体温度と相関があ ることが判明している。

【0009】個々の圧力センサについては、温度補償回路が組み込まれているものも存在するが、この場合においても、温度ドリフトが例えば0.05%/℃であれば、20℃から100℃に変化する場合には、4%の出力ドリフトが発生することになる。

【0010】圧力センサには各種の形式があるが、一例としてストレインゲージを考えてみる。ストレインゲージは圧力を電圧に変換し、横軸を圧力にとると縦軸が出力電圧に対応した関係になる。当然、絶対圧力がゼロの場合に出力電圧はゼロになり、絶対圧力の増加に従って出力電圧が増加することが期待される。

【0011】圧力センサに加わる圧力がゼロのときのセンサ出力をゼロ点出力と云い、ゼロ点が温度変化に応じて変動する温度ドリフトをゼロ点出力ドリフトと呼ぶ。

これに対し、加圧時のセンサ出力の温度ドリフトをスパン出力ドリフトと呼ぶ。正確なセンサ出力を得るためには、ゼロ点出力ドリフトとスパン出力ドリフトの両者の調整が必要になる。

【0012】具体的に考えると、仮に圧力センサのゼロ点出力ドリフトが無く、そのゼロ点電圧が0(V)であるとしよう。今、流体の絶対圧力が1.0(×10²k PaA)、即ち1atmのとき、圧力センサの出力電圧が20mVであるとする。この状態で流体温度を変化させた場合、当然にその出力電圧は20mVから変化する。この変動が前述したスパン出力ドリフトである。実際には、ゼロ点出力ドリフトがあるため、任意圧力におけるスパン出力ドリフトにはゼロ点電圧が加算されて出現する。

【0013】このように、上流側圧力P₁又は下流側圧力P₂を測定しながらオリフィス通過流量を制御する圧力式流量制御装置では、圧力センサの出力電圧にゼロ点出力ドリフトとスパン出力ドリフトという温度変動特性が含まれる。従って、その出力電圧を直接圧力に変換すると圧力P₁、P₂に誤差が含まれる事になり、前述した流量式に従って演算流量Qcに誤差を導入することになる。この問題が圧力式流量制御装置における温度ドリフトの問題である。

【〇〇14】圧力センサが有するゼロ点及びスパンの温度ドリフト特性は個々の圧力センサにより異なるが、圧力センサの温度ドリフトを補正する方法を確立するすることによって、正確なセンサ出力を得ることが要望されてきた。

【0015】従って、本発明に係る温度ドリフト補正装 置は、温度変動による圧力センサのゼロ点出力ドリフト 及び/又はスパン出力ドリフトを制御回路や制御ソフト により自動補正して、流体圧力を正確に測定することを 目的とする。また、この圧力センサを有した圧力制御装 置や圧力式流量制御装置に関しても、圧力センサのゼロ 点出カドリフト及び/又はスパン出力ドリフトを補正し て、正確に圧力制御や流量制御を実現する圧力制御装置 や圧力式流量制御装置を開発することを目的とする。 【0016】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、流体 40 圧力を測定する圧力センサにおいて、流体温度を測定する温度センサと、流体温度と圧力センサ出力ドリフトの 関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場合 にメモリ手段のデータから圧力センサ出力ドリフト量を 演算し、この演算出カドリフト量により圧力センサの出力ドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段から構成され、流体温度が変動しても流体圧力を正確に測定することを特徴とする圧力センサの温度ドリフト補正装置である。

【0017】請求項2の発明は、圧力制御用のコントロ 50 一ルパルプと流体圧力を測定する圧力センサから構成さ

6

れた圧力制御装置において、流体温度と圧力センサ出力 ドリフトの関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変 化した場合にメモリ手段のデータから圧力センサ出力ド リフト量を演算し、この演算出カドリフト量により圧力 センサの出カドリフトを消去補正する温度ドリフト補正 手段から構成され、流体温度が変動しても流体圧力を正 確に制御することを特徴とする圧力制御装置の温度ドリフト補正装置である。

【0018】請求項3の発明は、流量制御用のオリフィスと、オリフィスの上流側配管に設けたコントロールバルブと、オリフィスとコントロールバルブの間に設けて上流側圧カP₁を検出する上流側圧カセンサから構成され、上流側圧カP₁によりオリフィス通過流量を制御する圧力式流量制御装置において、流体温度を測定する温度センサと、流体温度と上流側圧カセンサの出カドリフトの関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場合にメモリ手段のデータから上流側圧カセンサの出カドリフト量により上流側圧カセンサの出カドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段から構成され、流体温度が変動しても流体流量を正確に制御することを特徴とする圧力式流量制御装置の温度ドリフト補正装置である。

【0019】請求項4の発明は、流量制御用のオリフィ スと、オリフィスの上流側配管に設けたコントロールバ ルブと、オリフィスとコントロールバルブの間に設けて 上流側圧力P₁を検出する上流側圧力センサと、オリフ イスの下流側配管に設けられて下流側圧力Pっを検出す る下流側圧カセンサとから構成され、上流側圧カP,と 下流側圧力Pっによりオリフィス通過流量を制御する圧 力式流量制御装置において、流体温度を測定する温度セ ンサと、流体温度と上流側圧力センサ及び下流側圧力セ ンサの出力ドリフトの関係を格納するメモリ手段と、流 体温度が変化した場合にメモリ手段のデータから上流側 圧力センサ及び下流側圧力センサの出力ドリフト量を演 算し、この演算出カドリフト量により上流側圧カセンサ 及び下流側圧力センサの出力ドリフトを消去補正する温 度ドリフト補正手段から構成され、流体温度が変動して も流体流量を正確に制御することを特徴とする圧力式流 量制御装置の温度ドリフト補正装置である。

【 O O 2 O 】請求項5の発明は、前記メモリ手段は圧力がゼロのときに流体温度と圧力センサのゼロ点出カドリフトの関係を格納し、前記温度ドリフト補正手段は、流体温度が変化した場合にメモリ手段のゼロ点出カドリフト量を演算し、この演算ゼロ点出カドリフト量により圧カセンサのゼロ点出カドリフトを消去補正する請求項1、2、3又は4に記載の温度ドリフト補正装置である。

【0021】請求項6の発明は、前記メモリ手段は任意 圧力におけるに流体温度と圧力センサのスパン出力ドリフトの関係を格納し、流体温度が変化した場合にメモリ 手段からスパン出カドリフト量を演算し、圧力センサの 出力又はこの出力の増幅量から前記演算スパン出カドリ フト量を消去補正する請求項1、2、3又は4に記載の 温度ドリフト補正装置である。

【0022】請求項7の発明は、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の温度ドリフト補正装置において、ガスを流体として流通させ、このガス圧力又はガス流量を制御するガス供給システムである。

[0023]

10 【発明の実施の形態】本発明者等は、温度変化による圧 カセンサのゼロ点出カドリフトやスパン出カドリフトを 分析することによって、圧力センサのみならず、圧力セ ンサを使用する圧力制御装置や圧力式流量制御装置の温 度ドリフトをも補正できる方法を創案するに到った。以 下に、本発明に係る圧力式流量制御装置の温度ドリフト 補正装置の実施形態を図面に従って詳細に説明する。

【0024】図1は本発明に係る臨界条件を利用した圧力式流量制御装置による流量制御の構成図である。この圧力式流量制御装置2は、供給される流体が臨界条件にある場合、即ちオリフィス4から流出する流体の流体速度が音速である場合を前提としているため、流量はQ=KP₁で表され、圧力測定は上流側圧力センサ10だけで行なわれる。

【0025】この圧力式流量制御装置2には、オリフィス孔4aを形成したオリフィス4、上流側配管6、下流側配管8、上流側圧力センサ10、温度センサ14、制御回路16、バルブ駆動部20及びコントロールバルブ22が配置されている。

【0026】制御回路16は電子回路とマイクロコンピュータと内蔵プログラムを中心に構成されているが、電子回路だけで構成してもよいし、電子回路とパーソナルコンピュータで構成してもよい。この制御回路16は、図示しない増幅回路やA/D変換器などの電子回路系と、実験流量式による流量Qcを演算する流量演算手段17と、流すべき設定流量Qsを指令する流量設定手段18と、演算流量Qcと設定流量Qsの流量差△Q(=QsーQc)を計算する比較手段19から構成されている。流量差△QはQcーQsにより算出されてもよい。【0027】この圧力式流量制御装置2の上流側には、

40 高圧ガスを内蔵するガスタンク24と、この高圧ガスの ガス圧力を適度に調整するレギュレータ26と、このガ スを供給側配管27からコントロールバルブ22に供給 するバルブ28が接続されている。

【0028】また、圧力式流量制御装置2の下流側には、流量制御されたガスを流通させる制御側配管29と、このガスをチャンバー32に供給するバルブ30と、真空ポンプ34が連結されている。チャンバー32は供給される原料ガスから目的ガスを生成する反応室で、例えばH2とO2の原料ガスからH2Oの水分ガス50を生成する反応室である。

【0029】次に、この圧力式流量制御装置2の制御動 作を説明する。上流側では供給側配管27に所定圧力の ガスが供給され、更にバルブ駆動部20により開閉制御 されるコントロールバルブにより上流側配管6への供給 流量が制御される。同時に、下流側ではドライポンプ3 4により下流側配管8が低圧に設定されている。

【0030】真空ポンプ34による排気で、下流側配管 8内の下流側圧力P2は上流側圧力P1よりもかなり小さ く設定され、少なくとも P_2/P_1 <約0.5の臨界条件 は常に満足されるように自動的に設定されるから、オリ フィス孔4aから流出するガス速度は音速となってい る。従って、オリフィス4の通過流量QはQ=KP、が 成立している。

【0031】上流側圧カP1は圧力センサ10により計 測される。正確な圧力測定をするため、圧力センサ10 のセンサ部分はガス流に接触して配置され、しかもガス 流を撹乱しないように、そのセンサ部分は極めて小さく 設計されている。従って、センサ部分はガス温度Tに等 しくなっている。

【0032】またガス温度Tも温度センサ14により計 測されている。温度センサ14はガス流を撹乱しないよ うにオリフィス4の近傍温度を測定しており、ガスとオ リフィスが熱平衡にあれば両者の温度は等しくなるか ら、オリフィス温度をガス温度として測定する。

【0033】上流側圧カP1とガス温度Tは電圧として 得られ、図示しない増幅回路やA/D変換器によりデジ タル信号になる。これらのデジタル信号は流量演算手段 17に入力され、ガス温度Tとガス物性から比例係数 K が算出され、また上流側圧カP,を利用して、演算流量 QcがQc=KP」により算出される。

【0034】流量設定手段18からは目的となる設定流 量Qsが入力されており、比較手段19により流量差△ Qが $\Delta Q = Q$ s - Qc として演算される。この流量差 Δ QとしてAQ=Qc-Qsが用いられてもよい。

【0035】この流量差ΔQはバルブ駆動部20に出力 され、 Δ Q をゼロにする方向にコントロールバルブ22 の開度を調整する。この開度調整により、ガスの上流側 圧力 P_1 が可変調整され、 $Q_C = KP_1$ によって得られる 演算流量Qcが設定流量に等しくなるように制御され

【0036】前述したように、圧力センサ10のセンサ 部分はガス温度下に等しくなっており、ガス温度下が変 動すると、それに連れてセンサ部分の温度も変化する。 しかし、圧力センサは温度依存性を有し、圧力センサの 出力電圧が温度変動に従ってドリフトする。この出力ド リフトの補正について次に述べる。

【〇〇37】図2は圧力式流量制御装置のゼロ点出力ド リフト補正用の簡易ブロック回路図である。圧力センサ 10の出力電圧 v は固定増幅回路 42及び可変増幅回路 44によって圧力電圧Vにまで増幅される。圧力電圧V

はA/D変換器48を介してCPU41に入力される。 また、固定増幅回路42の出力は他の可変増幅回路46 にも出力され、この可変増幅回路46の出力も圧力電圧 Vを与え、上流側圧力 P_1 として表示板に表示される。

【0038】この実施形態で用いられる圧力センサ10 は、例えば絶対圧でP₁=7気圧、即ち7 (×10²kP aA)を感受したときに100mVを出力すると仮定す る。この圧力センサ10を用いてP、=0~3 (×10² k PaA)の範囲で上流側圧力P₁を制御すると、圧力 10 センサ10の出力電圧vはv=0~42.86mVの範 囲になる。

【0039】この出力電圧vの最大電圧42.86mV をフルスケールの5 Vに増幅するとすれば、増幅率は1 17倍となる。この実施形態では、117倍の増幅率 は、前記固定増幅器42で100倍、可変増幅器44、 46で1.17倍にして実現されている。

【〇〇4〇】しかし、圧力センサ10の出力は温度変動 によりドリフトする。圧力ゼロのときにおける出力ドリ フトをゼロ点出力ドリフトと呼び、任意の圧力を受けて 20 いるときのドリフトを出力ドリフトと呼ぶことにする。 【〇〇41】ゼロ点出カドリフトは固定増幅器42のオ フセット端子42aを調整することによって補正され る。ゼロ点出カドリフト補正はオフセット用D/A変換 器40によって実現される。即ち、圧力がゼロのときに 出力電圧vがある値voを示したとき、このゼロ点出力 ドリフト電圧 voをゼロにするように、オフセット端子 42aに一voを入力する。この結果、圧力がゼロのと きに、voが固定増幅器42に入力しても、実効入力電 圧は v_o +($-v_o$)=0となり、ゼロ点出カドリフト補 30 正が行なわれる。

【OO42】オフセット用D/A変換器40は、粗調整 用(ROUGH)のD/A変換器40aとバッファ40 c、微調整用(FINE)のD/A変換器40bとパッ ファ40d及び合成用のバッファ40eから構成され る。このように、粗調整用回路と微調整用回路により、 ゼロ点出カドリフト電圧voを反転したゼロ点補正電圧 ―voをオフセット端子42aに印加して、ゼロ点出力 ドリフトを消去するように補正している。

【0043】図3はゼロ点出力ドリフト補正とフルスケ 40 一ル設定の説明図である。横軸は上流側圧カP、を示 し、縦軸は出力電圧∨と圧力電圧∨を示している。圧力 範囲は $P_1 = 0 \sim P_{1m}$ で、最大圧力は $P_{1m} = 3$. O (× 10²k PaA)とする。ガス温度TがT_oのとき、ゼロ 点出カドリフトはvo=-2.0mV、最大圧力におい てセンサ最大出力はvュ=40.8mVであるとする。 【〇〇44】voとviを結んだドット線が圧力センサ1 Oの温度特性である。オフセット端子42aにーvoを 印加すると、 v_o + $(-v_o)$ =0により v_o は0mVへ と消去補正され、Zero-Adjで示されている。その結果、

50 最大圧力 P_{1m} においても v_1 +($-v_0$) = 40.8+

10

2. 0=42. 8mVになる。従って、圧力センサ10の出力はゼロ点ドリフト補正により0~42. 8mVへと補正される。この補正は破線により表されている。

【0045】次に、この圧力センサ100フルスケール設定を行なう。Zero-Adj後の圧力センサの出力が $0 \sim v_1 + (-v_0)$ 、即 $50 \sim 42.8 \, mV$ であるとき、これをフルスケール5Vに設定する。即 $5.42.8 \, mV$ を5Vに増幅するため、可変増幅器44.46の増幅率を1.17とし、その結果、2 段増幅率は $M=100 \times 1.17 = 117$ に設定される。この補正はSpan-Adjで表されている。

【 0046 】 従って、最大電圧 V_{m} は V_{m} = M (v_{1} v_{0}) で与えられ、任意圧力 P_{1} での圧力センサ 100 出力 v は、V = M ($v - v_{0}$) へと増幅される。この増幅 出力 V は実線によって表され、臨界条件ではこの実線は V = a (T_{0}) P_{1} を表す。比例定数 a (T_{0}) はガス温度 T が T_{0} における比例定数を与える。

【0047】図4は圧力センサの出力ドリフトを測定する説明図である。圧力センサ10は圧力式流量制御装置に組み込んだ状態で恒温槽50に設置し、恒温槽50の外側に配置した真空ポンプDPおよび基準圧力発生器52を配管で圧力式流量制御装置と接続する。

【 0048】真空ポンプDPで配管内をゼロ圧力(真空)、即ち P_1 =0(× 10^2 kPaA)に設定し、温度を変化させながら圧力センサ10のゼロ点出力ドリフト電圧 v_0 を測定する。また、パルプを切替えて基準圧力発生器52の圧力 P_1 を特定の圧力に設定し、温度を変化させながら圧力センサ10の出力電圧vを測定する。

【OO49】図5は圧力センサのゼロ点出カドリフト(ZERO DRIFT)の一例の温度特性図である。横軸はガス温度 T であり、縦軸はゼロ点出カドリフト電圧 v_0 の相対比率 k(T)である。O%のドットラインはドリフトが無い理想的な Ideal Lineを示し、折線は実際に測定されたゼロ点出カドリフトを与える。このドリフトはOででゼロ、85℃で2. O%程度である。この相対比率 k(T)をゼロ点出カドリフト電圧 v_0 に換算して、前述したオフセット端子 42aに印加する。

【○○5○】図6は圧力センサの出力ドリフト(SPAN DRIFT)の温度特性図である。横軸はガス温度 Tであり、 縦軸は特定圧力に対するスパン出力ドリフト電圧 vの相対比率 Δ (T)である。3種類の圧力、1.5、2. ○、3.○(×10²k PaA)に関して出力ドリフトが測定され、出力ドリフトは圧力が変わると僅かな違いを見せるだけである事が分かった。例えば60℃以下のような温度が低い場合には、圧力の違いは無視できることが分かる。従って、これらのドリフトを平均して、任意圧力に対し同一幅の出力ドリフトがあるとして補正をすることができる。

【0051】図7は圧力式流量制御装置の制御回路の詳細プロック構成図である。圧力センサ10、固定増幅器

42、可変増幅器44・46、A/D変換器48、オフセット用D/A変換器40は図2と同一であるから、その説明を省略する。

【0052】温度センサ14により測定されたガス温度出力は、固定増幅器56により増幅されてガス温度Tとなり、A/D変換器58を介してCPU41に入力される。このガス温度Tは温度ドリフト補正手段60とガス温度補正手段68に入力される。

【0053】温度ドリフト補正手段60は、ゼロ点補正 10 手段62、メモリ手段64及びスパン補正手段66から 構成されている。メモリ手段64には、図5に示される ゼロ点出カドリフトの相対比率k(T)と図6に示され る出カドリフトの相対比率Δ(T)のデータが格納され ている。

【0054】ガス温度Tがゼロ点補正手段62に入力されると、メモリ手段64から必要なゼロ点出力ドリフトの相対比率データk・・が取り出され、ガス温度Tにおける相対比率k(T)が計算される。この計算された相対比率k(T)からゼロ点出力ドリフト電圧voが演算20 され、この反転電圧—voがオフセット用D/A変換器40を介してオフセット端子42aに印加されて、ゼロ点出力ドリフトが自動的に補正される。

30 【0056】また、ガス温度Tがガス温度補正手段68 に入力されると、物性データと合わせて正確な比例定数 Kが算出され、この比例定数Kと上流倒圧力P₁により 演算流量QcがQc=KP₁として算出される。この演 算流量QcはD/A変換器72と固定増幅器74を介して出力され、図示しない外部表示装置に表示される。

【0057】流量設定手段18から目的流量として入力された設定流量Qsは、固定増幅器76とA/D変換器78を介して比較手段19に入力される。一方、ガス温度補正手段68から演算流量Qcが比較手段19に入力され、流量差AQがAQ=Qc-Qsとして計算され、

υ c16、加量左ΔQがΔG=Gc-Gsとして計算され、 パルブ駆動部20に出力される。

【0058】パルブ駆動部20は、この流量差△Qをゼロにするようにコントロールパルブ22の弁開度を開閉調整し、この開閉によって上流側圧力P₁が制御される。この結果、△Qはゼロとなり、演算流量Qcは設定流量Qsに一致するように自動制御される。

【0059】図8は、本発明に係るゼロ点補正手段62 の作動フロー図である。ステップm1でガス温度Tを入 力され、m2ではメモリ手段64の相対比率データを基 50 礎にしてガス温度Tでの相対比率k(T)を導出する。 m3では、この相対比率 k (T) と圧力センサ 100 出力電圧 v からゼロ点出力ドリフト電圧 v o を演算し、m 4でこの電圧 v o を反転させた後、m 5 で -v o をオフセット端子 4 2 に印加する。このようにして、ゼロ点が補正される。

【0060】図9は、本発明に係るスパン補正手段66の作動フロー図である。ステップn1ではガス温度Tが入力される。同時に、n2では圧力センサ10により計測された出力電圧Vとして入力される。

【0061】 n3では、メモリ手段64の相対比率データを基礎にしてガス温度 Tでのドリフトの相対比率 Δ (T)が導出される。n4では、この相対比率 Δ (T)と前記圧力電圧Vから温度補正されて温度補正出力電圧Vが算出され、この温度補正出力電圧Vが正確な上流側圧力 P_1 となる。n5では、この上流側圧力 P_1 がガス温度補正手段68に入力される。

【0062】図10は、本発明に係る非臨界条件を利用 した圧力式流量制御装置による流量制御の構成図であ る。この圧力式流量制御装置2は、供給される流体が非 臨界条件にある場合、即ちオリフィス4から流出する流 体の流体速度が音速より低い場合を前提としている。

【0063】流体が非臨界条件にあるとき、オリフィス通過流量の理論流量式の一つは、非圧縮性流体に対して成立するベルヌーイの定理から導出したもので、Q=K $P_2^{1/2}$ (P_1-P_2) $^{1/2}$ で与えられる。この実施形態では、この理論流量式を使用して、ガス流量を制御する。

【0065】図1との相違点は、下流側圧力P₂を下流側圧力センサ12により測定して制御回路16に入力する電子回路系及びソフト系が付加されることである。この電子回路系及びソフト系としては、上流側圧力センサ10に連続する電子回路系及びソフト系と同一のものがそのまま並行して配置される。

【0066】図11は図10の制御回路の詳細ブロック 構成図である。電子回路系としては、下流側圧力センサ 12に連続して、固定増幅器(AMP)、可変増幅器 (VAMP)、表示用の可変増幅器(VAMP)、A/ D変換器及びオフセット用のD/A変換器がある。これ らの電子回路系はCPU41の入力系に配置される。 【0067】また、ソフト系としては、上流側圧力セン サ10のソフト系を共用する。即ち、下流側圧力センサ 12のゼロ点出カドリフトとスパン出カドリフトのデー タを格納するメモリ手段64、これらのデータを使用し てゼロ点出カドリフトを補正するゼロ点補正手段62と 12

スパン出力ドリフトを補正するスパン補正手段666がある。これらのソフト系はCPU41の中に構成される。【OO68】このような電子回路系とソフト系を配置し、制御回路16の中に $Qc=KP_2^{1/2}(P_1-P_2)^{1/2}$ を演算する流量演算手段16を配置し、同時に流量 差 $\Delta Q=Qs-Qc$ を演算する比較手段19を配置して、目的とする流量を得るように流量制御を行なう。他の部材の作用・効果はQS1と同様であるから、その説明を省略する。

10 【0069】図12は、本発明に係る非臨界条件を利用 した改良型圧力式流量制御装置による流量制御の構成図 である。この圧力式流量制御装置2は、供給される流体 が非臨界条件にある場合を前提としているが、改良され た理論流量式を使用する。

【0070】実際のガス流体は膨張性と圧縮性を有しているため、非圧縮性を前提としたベルヌーイの定理は近似的にしか成立しない。従って、 $Q_C = KP_2^{1/2}$ ($P_1 - P_2$) $^{1/2}$ で表される流量式は近似式でしかない。本発明者等は、この近似式を改良して実際の流量を高精度に20 再現できる流量式を検討した。

【0071】この改良された流量式として、 $Qc=KP_2^m$ (P_1-P_2) nを使用することにした。指数として二つのパラメータm、nを使用し、実際の流量をこの流量式でフィットすることにより、mとnを導出した。得られた値は、m=0. 47152、n=0. 59492であった。これらのパラメータを使用することにより、実際の流量を高精度に再現する事ができた。

【0072】この実施形態では、改良された流量式を用いて流量演算手段17を構成しており、この点を除けば30 図10に示す実施形態と全く同様である。即ち、上流側圧力センサ10ど下流側圧力センサ12の温度ドリフトを補正する構成は図11と同一であるから、その説明は省略する。

【0073】上述では、本発明を圧力式流量制御装置について説明したが、圧力センサ自体の温度ドリフト(ゼロ点出カドリフトとスパン出カドリフト)の補正にも適用できる。また、圧力センサが組み込まれた圧力制御装置の温度ドリフト補正にも使用できる。

【0074】本発明は上記実施形態に限定されるもので 40 はなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲における 種々の変形例・設計変更などをその技術的範囲内に包含 することは云うまでもない。

【0075】

【発明の効果】請求項1の発明によれば、圧力センサ自体の出力の温度ドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段を設けることによって、正確に圧力を検出できる圧力センサを提供できる。

【0076】請求項2の発明によれば、圧力センサとコントロールバルブを有した圧力制御装置において、圧力 センサの出力の温度ドリフトを消去補正する温度ドリフ ト補正手段を設けることによって、圧力を正確に検出しながら精密に圧力制御できる圧力制御装置を提供できる。

【 O O 7 7】請求項3の発明によれば、流体温度と上流側圧力センサの出力ドリフトの関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場合にメモリ手段のデータから上流側圧力センサの出力ドリフト量を演算し、この演算出力ドリフト量により上流側圧力センサの出力ドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段を有するから、どのような温度特性を有する圧力センサを用いても、その温度特性をメモリ手段に格納するだけで、上流側圧カト」を正確に検出することができる。従って、Qc=KP」を流量式として使用する圧力式流量制御装置において、正確な流量制御を達成することができる。

【0078】請求項4の発明によれば、流体温度と上流側圧力センサ及び下流側圧力センサの出力ドリフトの関係を格納するメモリ手段と、流体温度が変化した場合にメモリ手段のデータから上流側圧力センサ及び下流側圧力センサの出力ドリフト量を演算し、この演算出力ドリフト量により上流側圧力センサ及び下流側圧力センサの出力ドリフトを消去補正する温度ドリフト補正手段から構成されるから、どのような温度特性を有する圧力センサを用いても、その温度特性をメモリ手段に格納するだけで、上流側圧力 P_1 と下流側圧力 P_2 を正確に検出することができる。従って、 $Q_C = KP_2^{1/2}(P_1 - P_2)$ 「2又は $Q_C = KP_2^{1/2}(P_1 - P_2)$ 「2、下流量記力式流量制御装置において、正確な流量制御を達成することができる。

【0079】請求項5の発明によれば、圧力がゼロのときに流体温度と圧力センサのゼロ点出カドリフトの関係をメモリ手段に格納するから、流体温度が任意の温度に変化してもメモリ手段のデータからゼロ点出カドリフト量により圧力センサのゼロ点出カドリフトを消去補正することができる。

【0080】請求項6の発明によれば、任意圧力のときに流体温度と圧力センサのスパン出力ドリフトの関係をメモリ手段に格納するから、任意の圧力状態で流体温度が任意温度に変化してもメモリ手段のデータからスパン出力ドリフト量を演算でき、この演算スパン出力ドリフト量により圧力センサのスパン出力ドリフトを自動的に消去補正することができる。

【 0 0 8 1 】請求項7の発明によれば、流通するガス流体の温度がどのように変化しても、正確にガスの圧力を検出でき、半導体製造装置や化学品製造装置などにおいてガス流体の制御効率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

14

【図1】本発明に係る臨界条件を利用した圧力式流量制 御装置による流量制御の構成図である。

【図2】圧力式流量制御装置のゼロ点出力ドリフト補正 用の簡易ブロック回路図である。

【図3】ゼロ点出カドリフト補正とフルスケール設定の 説明図である。

【図4】圧力センサの出力ドリフトを測定する説明図である。

【図5】圧カセンサのゼロ点出カドリフト (ZERO DRIF 10 T) の温度特性図である。

【図6】圧力センサの出力ドリフト(SPAN DRIFT)の温度特性図である。

【図7】圧力式流量制御装置の制御回路の詳細ブロック 構成図である。

【図8】本発明に係るゼロ点補正手段62の作動フロー図である。

【図9】本発明に係るスパン補正手段66の作動フロー 図である。

【図10】本発明に係る非臨界条件を利用した圧力式流 20 量制御装置による流量制御の構成図である。

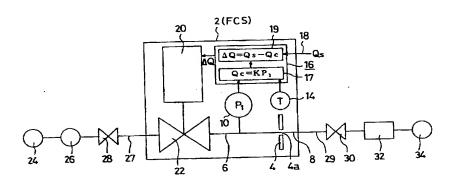
【図11】図11は図10の制御回路の詳細ブロック構成図である。

【図12】本発明に係る非臨界条件を利用した改良型圧 力式流量制御装置による流量制御の構成図である。

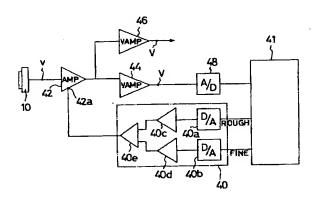
【符号の説明】

2は圧力式流量制御装置、4はオリフィス、4aはオリ フィス孔、6は上流側配管、8は下流側配管、10は上 流側圧力センサ、12は下流側圧力センサ、14は温度 センサ、16は制御回路、17は流量演算手段、18は 30 流量設定手段、19は比較手段、20はパルブ駆動部、 22はコントロールバルブ、24はガスタンク、26は レギュレータ、27は供給側配管、28はバルブ、29 は制御側配管、30はバルブ、32はチャンバー、34 は真空ポンプ、40はオフセット用D/A変換器、40 aは粗調整用D/A変換器、40bは微調整用D/A変 換器、40cはバッファ、40dはバッファ、40eは パッファ、41はCPU、42は固定増幅器、42aは オフセット端子、44は可変増幅器、46は可変増幅 器、48はA/D変換器、50は恒温槽、52は基準圧 40 力発生器、56は固定増幅器、58はA/D変換器、6 0は温度ドリフト補正手段、62はゼロ点補正手段、6 4はメモリ手段、66はスパン補正手段、68はガス温 度補正手段、72はD/A変換器、74は固定増幅器、 76は固定増幅器、78はA/D変換器、DPは真空ポ ンプ、P」は上流側圧力、P。は下流側圧力、Qcは演算 流量、Qsは設定流量、AQは流量差、vOはゼロ点出 カドリフト電圧、vは出力電圧、Vは圧力電圧。

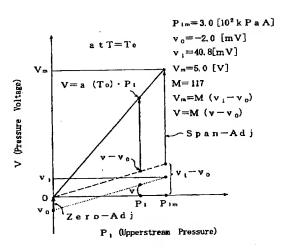
【図1】



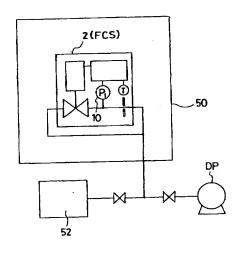
【図2】



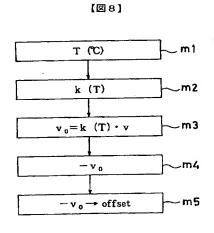
【図3】



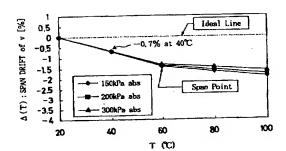
【図4】



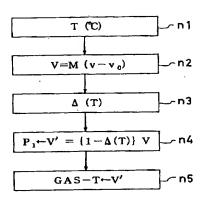
| (E) 5 | 2.0% at 85°C | 2.0% at 85°



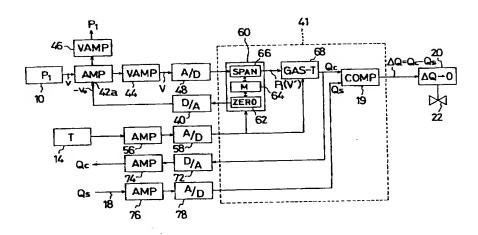
【図6】



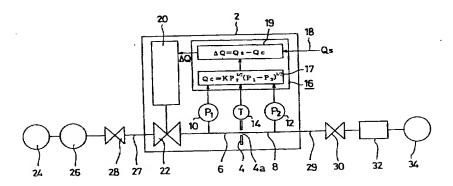
【図9】



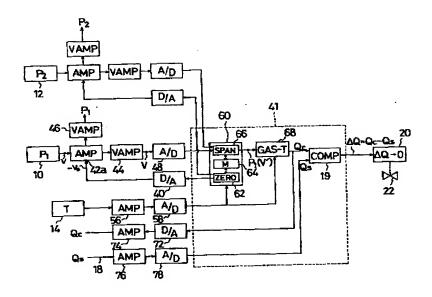
【図フ】



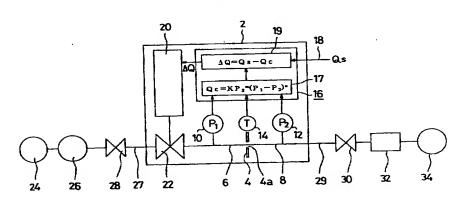
【図10】



【図11】



【図12】



フロントページの続き

(72)発明者 大見 忠弘

宮城県仙台市青葉区米ケ袋2丁目1番17-301号

(72)発明者 杉山 一彦

山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1

東京エレクトロン株式会社内

(72)発明者 西野 功二

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 宇野 富雄

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 中村 修

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 松本 篤諮

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 土肥 亮介

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

(72)発明者 池田 信一

大阪府大阪市西区立売堀2丁目3番2号

株式会社フジキン内

Fターム(参考) 2F030 CC11 CD15

2F055 AA39 BB03 BB05 CC60 DD20

EE40 FF02 GG32

5H316 AA01 BB01 CC08 DD08 EE02

ES06 FF02 FF06 FF17 FF23

GG01 GG11 HH04 HH12 JJ03

JJ13 KK02 KK04